

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第3区分

【発行日】平成16年12月24日(2004.12.24)

【公開番号】特開2001-9713(P2001-9713A)

【公開日】平成13年1月16日(2001.1.16)

【出願番号】特願平11-185357

【国際特許分類第7版】

B 2 4 B 37/04

H 0 1 L 21/304

【F I】

B 2 4 B 37/04 Z

H 0 1 L 21/304 6 2 2 L

【手続補正書】

【提出日】平成16年1月19日(2004.1.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

研磨面を有した研磨テーブルと、研磨対象物を保持しつつ研磨対象物を前記研磨面に押圧する少なくとも二個のトップリングとを有した研磨処理部を備え、

前記少なくとも二個のトップリングはそれぞれ回転軸により支持され、研磨テーブル上で研磨対象物の研磨を行う研磨位置と研磨対象物を受け渡しする受け渡し位置との間を移動可能になっており、前記少なくとも二個のトップリングは前記研磨位置に同時に位置することができる^{ことを特徴とする}ポリッキング装置。

【請求項2】

前記研磨面のドレッシングを行うドレッサーを備えたことを特徴とする請求項1記載のポリッキング装置。

【請求項3】

前記トップリングおよびドレッサー毎に液体供給用のノズルが設けられていることを特徴とする請求項2記載のポリッキング装置。

【請求項4】

前記受け渡し位置にはトップリングとの間で研磨対象物の受け渡しを行うためのロードアンロード兼用プッシュが配置されていることを特徴とする請求項1記載のポリッキング装置。

【請求項5】

一つのロードアンロード兼用プッシュと一つのトップリングを対応させ、その組合せを一つの研磨テーブルに対し2組以上持つことを特徴とする請求項4記載のポリッキング装置。

【請求項6】

一つのロードアンロード兼用プッシュで二つのトップリングとの間で、研磨対象物を受け渡し可能としたことを特徴とする請求項4記載のポリッキング装置。

【請求項7】

第一のトップリングが前記研磨位置で研磨している最中に、第二のトップリングが前記受け渡し位置で研磨対象物を受け取った後待機し、第一のトップリングによる研磨終了と同時に、第二のトップリングによる研磨を行うことができる第一の研磨方法と、第一のトッ

プリングが前記研磨位置で研磨している最中に、第二のトップリングが前記研磨位置で第二の研磨対象物の研磨を行うことができる第二の研磨方法を選択可能であることを特徴とする請求項1記載のポリッシング装置。

【請求項8】

前記第二の研磨方法において、第一のトップリングと第二のトップリングで異種材料を表面に有した研磨対象物を研磨し、第二のトップリングによる第二の研磨時間が第一のトップリングによる第一の研磨時間と同じかそれより短いことを特徴とする請求項7記載のポリッシング装置。

【請求項9】

複数の研磨処理部を有することを特徴とする請求項1乃至8のいずれか1項に記載のポリッシング装置。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0008

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0008】

【課題を解決するための手段】

上記課題を解決するため、本発明は、研磨面を有した研磨テーブルと、研磨対象物を保持しつつ研磨対象物を前記研磨面に押圧する少なくとも二個のトップリングとを有した研磨処理部を備え、前記少なくとも二個のトップリングはそれぞれ振動軸により支持され、研磨テーブル上で研磨対象物の研磨を行う研磨位置と研磨対象物を受け渡しする受け渡し位置との間を移動可能になっており、前記少なくとも二個のトップリングは前記研磨位置に同時に位置することができることを特徴とするものである。